課題番号 :F-17-NM-0012

利用形態 :機器利用

利用課題名(日本語) :SrTiO3の絶縁体金属転移を用いたニューロモルフィック素子の作製

Program Title (English): Neuromorphic devices based on the insulator-to-metal transition of SrTiO<sub>3</sub>.

利用者名(日本語) :井上公

Username (English) : I. H. Inoue

所属名(日本語) :国立研究開発法人産業技術総合研究所

Affiliation (English) : National Institute of Advanced Industrial Science and Technology

キーワード/Keyword:FET、SrTiO3、HfO2、パリレン、ニューロモルフィック、成膜・膜堆積

### 1. 概要(Summary)

SrTiO<sub>3</sub>チャネル上に、パリレン(6 nm)/HfO<sub>2</sub> (20 nm) 二層ゲート絶縁膜を用いて電界効果トランジスタ(FET)を作製した。このFETは絶縁体から2次元金属への相転移を起こす。これを利用して人工ニューロンと人工シナプスを作製することに成功した。

## 2. 実験(Experimental)

【利用した主な装置】原子層堆積装置(ALD)

【実験方法】産総研のクリーンルームでSrTiO3の単結晶基板(10mm角、0.5mm厚)上にまずパリレン(3 nm)を成膜する。ソース・ドレイン電極のパターンをリソグラフィで形成し、その部分のパリレンを除去した後、Tiを蒸着しリフトオフ。再び全体にパリレン(3 nm)を成膜する。次にNIMS微細加工PFのALDでチャネル部分のパリレン上にHfO2を20 nm積層。この試料を産総研に持ち帰り、ゲート電極等を形成してFETを完成させた。さらに、任意波形発生器、オシロスコープ、デジタルマルチメータなどを用いて、ニューロモルフィック素子としての特性評価を行った。

### 3. 結果と考察 (Results and Discussion)

我々のSrTiO3 FETは、ゲート電場の印加でSrTiO3中の正に帯電した酸素欠損がバルク内部へとドリフトしていく。これに応じて閾値電圧が徐々に小さくなり、最終的にはほぼOVに近いゲート電場で絶縁体チャネルから2次元金属チャネルへの相転移を制御できるようになる。酸素欠損の移動(閾値の変化)は緩やか(0.5 Hzほど)だが、絶縁体金属相転移の方は20 Hzほどの速さで起こり、生体との連携を考えた場合にニューロモルフィック素子としては好ましい速度である。さらにこの相転移は履歴を伴って進行するため、この時定数と履歴特性をうまく利用すると、生物の脳の構成要素であるシナプスとニューロンの働きを模倣させることが可能であることがわかった。

本研究では実際に、ゲートへの複数の入力シグナルの

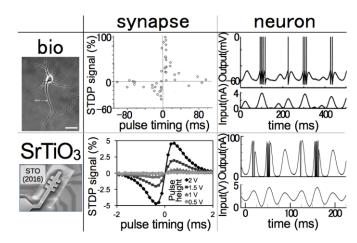


Fig.1: Behaviors of the biological synapse and neuron of a rat hippocampal neural cell (top row) compared with those of our artificial synapse and neuron made of a single SrTiO<sub>3</sub> FET (bottom row).

タイミングによってチャネルの伝導度が変化するspiketiming-dependent plasticity (STDP)というシナプスの 特性と、シグナルをその間隔に依存して蓄積するleakyintegrate and fire (LIF)というニューロンの特性を、とも に再現することに成功した (Fig. 1)。

# 4. その他・特記事項(Others)

本研究は科研費基盤A (15H02113)と科研費特研奨励 (25-03502)の支援を受けて行った。また、二層絶縁膜の評価のためTEM測定をNIMS微細構造解析プラットフォームにて行った。

### 5. 論文·学会発表(Publication/Presentation)

- (1) P. Stoliar, A. Schulman, A. Kitoh, A. Sawa I. H. Inoue, 2017 International Symposium on Nonlinear Theory and Its Applications (NOLTA), 2017年12月05日
- (2) P. Stoliar, A. Schulman, A. Kitoh, I. H. Inoue, 2017 IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM), 2017年12月06日
- 6. 関連特許(Patent)

なし。